

高功率激光与光学

数字全息形貌测量的基本特性分析

[刘诚](#) [朱健强](#)

(中国科学院 上海光学精密机械研究所, 高功率激光物理国家实验室, 上海 201800)

摘要: 在对数字全息技术进行严格理论分析的基础上, 本文指出随单个CCD像元的尺寸的减小可能被记录物体的横向尺寸将变大, 所允许的纵向尺寸却变小; 另一方面其系统误差和被测量值本身的大小成正比, 和横向分辨率成反比。

关键词: [数字全息](#) [误差分析](#) [分辨率](#) [形貌测量](#)

通信作者:

相关文章([数字全息](#)):

[数字全息形貌测量的基本特性分析](#)

[同轴全息术用于粒子场测量的数值模拟](#)

[\[PDF全文\]](#)

[\[HTML摘要\]](#)

[发表评论](#)

[查看评论](#)